

Печь быстрого термического отжига RTP 100-NV

Печь быстрого термического отжига RTP 100-NV

Производитель:

Unitemp

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Серия

RTP

Описание

Установки UniTemp серии RTP предназначены для быстрой высокотемпературной обработки полупроводниковых пластин и плоских подложек. Настольные компактные установки RTP прекрасно подходят как для R&D-применений, так и для пилотного и мелкосерийного производства.

Установка RTP 100-NV представляет собой модификацию печи RTP 100 с возможностью работы в высоком вакууме до 10^{-6} мбар. Печь работает с образцами до 100 мм в диаметре. Рабочая нагреваемая область: 100×100 мм. Загрузка подложек в рабочую камеру производится вручную. Максимальная температура процесса — до +1200 С. Максимальная скорость нагрева — до 150 К/с. Возможно проведение процессов в вакууме и газовой среде. Управление осуществляется при помощи встроенного микроконтроллера с сенсорным экраном.

Технические характеристики установки RTP 100-NV

Максимальный размер подложки	Диаметр 100 мм (4") , рабочая область 100×100 мм
Материал камеры	Кварцевое стекло (водоохлаждаемая камера)
Высота камеры	10 мм

Система загрузки подложек	<ul style="list-style-type: none"> • Поддон из кварцевого стекла • Опциональный держатель из пирографита или графита, покрытого SiC
Уровень вакуума	До 10 ⁻⁶ мбар (турбомолекулярный насос)
Максимальная температура процесса	До +1200 °С
Тип нагревателя	ИК-лампы (общая мощность 18 кВт)
Зоны нагрева	Верхняя и нижняя (программируемые)
Скорость нагрева	До 150 К/с
Скорость охлаждения	<ul style="list-style-type: none"> • От +1200 до +400 °С: 200 К/мин • От +400 до +100 °С: 30 К/мин • подложка охлаждается азотом
Температурный контроллер	Встроенный
Используемые газы	<ul style="list-style-type: none"> • Азот, кислород, форминг-газ • В базовой комплектации один РРГ 5 slm
Электропитание	3×32 А, 380 В, 3 фазы
Размер установки (Ш×Д×В)	505×504×580 мм (настольное размещение)
Вес печи	65 кг

Опции:

- Дополнительные газовые линии с РРГ (всего до 4 шт.)
- Держатели подложек из кварца, пирографита, графита, покрытого SiC
- Дополнительная термопара
- Различные вакуумные насосы
- Чиллер
- Дополнительная рабочая камера